# 平成 29 年度

## 修士論文

第四元素添加されたブロンズ法 Nb<sub>3</sub>Sn の

### 超伝導特性に関する研究

木内研究室 (学籍番号:16676118) 田邊 裕也

九州工業大学

情報工学府

先端情報工学専攻

指導教員:木内 勝 准教授

平成 30 年 2 月 9 日

# 目次

第一章	序論7
1.1	はじめに7
1.2	超伝導体の種類8
1.2.1	合金系超伝導体8
1.2.2	化合物系超伝導体10
1.2.3	銅酸化物超伝導体11
1.3	超伝導応用11
1.3.1	核磁気共鳴(NMR)分析器11
1.3.2	磁気共鳴画像(MRI)分析器12
1.3.3	国際熱核融合実験炉(ITER)13
1.4	Nb <sub>3</sub> Sn 線材の作製方法13
1.4.1	ブロンズ法14
1.4.2	内部拡散法15
1.4.3	PIT(Power In Tube)法15
1.5	元素添加効果16
1.5.1	Nb <sub>3</sub> Sn 層成長に及ぼす影響
1.5.2	ピン力密度Fpに及ぼす影響
1.5.3	上部臨界磁界B <sub>c2</sub> に及ぼす影響18
1.6	WHH 理論19
1.7	磁束クリープ・フローモデル20
1.7.1	磁束クリープ21
1.7.2	磁束フロー23
1.7.3	ピンポテンシャル23
1.7.4	磁束クリープ・フローモデル25
1.8	臨界電流密度Jcの向上の要因26
1.9	目的27

第二章	実験方法と試料の諸元	28
2.1	試料諸元	29
2.2	試料の断面観察	29
2.3	測定方法	34
2.3.1	臨界電流密度J <sub>c</sub> の測定	- 34
2.3.2	上部臨界磁界 <i>B</i> <sub>c2</sub> の評価	37
2.3.3	電界-電流密度(E-J)特性の評価	- 38

第三章	実験結果	39
3.1	<i>J</i> <sub>c</sub> -B特性	39
3.2	B <sub>c2</sub> -T特性	42
3.3	<i>E-J</i> 特性	44

第四章	解析及び考察	- 47
4.1	Nb <sub>3</sub> Sn 層の熱処理時間依存性	-47
4.2	推定した 0 K におけるB <sub>c2</sub>	- 49
4.3	ピン力密度のスケール則による解析	-51
4.4	磁束クリープ・フローモデルによる解析	54
4.5	研究における問題点と今後の課題点	-57

第五章	総括	5	8
-----	----	---	---

参考文献	 	 	62

謝辞------63

密業績	63
几本頃	05

# 図目次

図 1.1:様々な超伝導材料の臨界面	8
図 1.2: 4.2 K におけるB <sub>c2</sub> とT <sub>c</sub> と常伝導抵抗率ρ <sub>n</sub> の Ti の混合比率依存性	9
図 1.3: 2004 年における超伝導線材の年間製造量に占める各超伝導体の種類	9
図 1.4: 急熱急冷・変態法 Nb <sub>3</sub> Al とブロンズ法 Nb <sub>3</sub> Sn のJ <sub>c</sub> -B特性の比較	10
図 1.5: NMR の最大磁場の推移	12
図 1.6: ITER の内部構造	13
図 1.7: ブロンズ法の概略図	14
図 1.8: 内部拡散法の概略図	15
図 1.9: 様々な元素を添加した試料の Nb <sub>3</sub> Sn 層の熱処理時間依存性	16
図 1.10(a): 無添加 Nb <sub>3</sub> Sn 試料における結晶粒	17
図 1.10(b): Ti 添加された Nb <sub>3</sub> Sn 試料(Nb-4at%)における結晶粒	17
図 1.11: 無添加と Ti 添加された(Nb-4at%Ti)Nb <sub>3</sub> Sn 試料におけるJ <sub>c</sub> -B特性	18
図 1.12: 磁束バンドルとエネルギーの関係	20
図 1.13(a): L > dの場合の磁束バンドルの模式図	24
図 1.13(b): L < dの場合の磁束バンドルの模式図	25
図 1.14(a): 結晶粒微細化によるJcの向上の模式図	26
図 1.14(b): B <sub>c2</sub> の変化によるJ <sub>c</sub> の向上の模式図	26
図 2.1: ST-50 における試料断面	30
図 2.2: Mg-50 における試料断面	30
図 2.3: Hf-50 における試料断面	30
図 2.4: Ge-50 における試料断面	30
図 2.5: Ga-50 における試料断面	30
図 2.6: Ta-50 における試料断面	30
図 2.7: ST-100 における試料断面	31
図 2.8: Mg-100 における試料断面	31
図 2.9: Hf-100 における試料断面	31

図 2.10: Ge-100 における試料断面	31
図 2.11: Ga-100 における試料断面	31
図 2.12: Ta-100 における試料断面	31
図 2.13: ST-50 における Nb <sub>3</sub> Sn 層断面	32
図 2.14: Mg-50 における Nb <sub>3</sub> Sn 層断面	32
図 2.15: Hf-50 における Nb <sub>3</sub> Sn 層断面	32
図 2.16: Ge-50 における Nb <sub>3</sub> Sn 層断面	32
図 2.17: Ga-50 における Nb <sub>3</sub> Sn 層断面	32
図 2.18: Ta-50 における Nb <sub>3</sub> Sn 層断面	32
図 2.19: ST-100 における Nb <sub>3</sub> Sn 層断面	33
図 2.20: Mg-100 における Nb <sub>3</sub> Sn 層断面	33
図 2.21: Hf-100 における Nb <sub>3</sub> Sn 層断面	33
図 2.22: Ge-100 における Nb <sub>3</sub> Sn 層断面	33
図 2.23: Ga-100 における Nb <sub>3</sub> Sn 層断面	33
図 2.24: Ta-100 における Nb <sub>3</sub> Sn 層断面	33
図 2.25: 超伝導体の磁気ヒステリシスループの例	34
図 2.26 磁束線が侵入した場合の磁束密度の空間分布	36
図 2.27 磁束線が侵入した場合の電流の流れ方	36
図 2.28 磁気モーメントの磁界特性(m-B特性)の例	36
図 2.29: 磁気モーメントの温度特性( <i>m-T</i> 特性)の例	
図 2.30: <i>Δm</i> ′の温度依存性	
図 2.31: 磁気モーメントの時間依存性(磁化緩和測定)	38
図 3.1: ST-50 におけるJ <sub>c</sub> -B特性	39
図 3.2: Mg-50 における <i>J</i> <sub>c</sub> - <i>B</i> 特性	39
図 3.3: Hf-50 におけるJ <sub>c</sub> -B特性	39
図 3.4: Ge-50 におけるJ <sub>c</sub> -B特性	
図 3.5: Ga-50 におけるJ <sub>c</sub> -B特性	40
図 3.6: Ta-50 におけるJ <sub>c</sub> -B特性	40

図 3.7: ST-100 におけるJ <sub>c</sub> -B特性	40
図 3.8: Mg-100 におけるJ <sub>c</sub> -B特性	40
図 3.9: Hf-100 におけるJ <sub>c</sub> -B特性	40
図 3.10: Ge-100 におけるJ <sub>c</sub> -B特性	40
図 3.11: Ga-100 におけるJ <sub>c</sub> -B特性	41
図 3.12: Ta-100 におけるJ <sub>c</sub> -B特性	41
図 3.13: 50 時間試料におけるB <sub>c2</sub> -T特性	42
図 3.14: 100 時間試料におけるB <sub>c2</sub> -T特性	42
図 3.15: ST-50 における <i>E-J</i> 特性	44
図 3.16: Mg-50 における <i>E-J</i> 特性	44
図 3.17: Hf-50 における <i>E-J</i> 特性	44
図 3.18: Ge-50 における <i>E-J</i> 特性	44
図 3.19: Ga-50 における <i>E-J</i> 特性	45
図 3.20: Ta-50 における <i>E-J</i> 特性	45
図 3.21: ST-100 における <i>E-J</i> 特性	45
図 3.22: Mg-100 における <i>E-J</i> 特性	45
図 3.23: Hf-100 における <i>E-J</i> 特性	46
図 3.24: Ge-100 における <i>E-J</i> 特性	46
図 3.25: Ga-100 における <i>E-J</i> 特性	46
図 3.26: Ta-100 における <i>E-J</i> 特性	46
図 4.1: 700℃における添加元素別の熱処理時間依存性	48
図 4.2: 各試料における $B_{c2}$ の温度依存性をゼロ磁界まで外挿し、得られた $T_c^*$ の例	49
図 4.3:6 – 14 K における Hf-100 のピン力密度のスケール則の結果	52
図 4.4: 50 時間試料の 14 K におけるピン力密度のスケール則	52
図 4.5: 100 時間試料の 14 K におけるピン力密度のスケール則	53
図 4.6:50 時間試料の 6-14 K におけるJc-B特性の実験結果と解析結果の比較	55
図 4.7:100 時間試料の 6-14 K におけるJc-B特性の実験結果と解析結果の比較	56

# 表目次

表 2.1: 試料名と元素添加量28	
表 2.2: 50 時間試料の試料サイズ 29	
表 2.3: 100 時間試料の試料サイズ29	
表 3.1: 50 時間試料におけるB <sub>c2</sub> -T特性43	
表 3.2 100 時間試料におけるB <sub>c2</sub> -T特性43	
表 4.1: 各試料における時間の指数 <i>m</i> 48	
表 4.2: 第三元素添加により Nb <sub>3</sub> Sn 層の熱処理時間依存性が変化したときの時間の指数m	

#### -48

表 4.3:50 時間試料における推定される $T_c^*$ , $B_{c2}(0)$ , $B_{c2}^*(0)$	50
表 4.4: 100 時間試料における推定される <i>T</i> <sup>*</sup> <sub>c</sub> , <i>B</i> <sub>c2</sub> (0), <i>B</i> <sup>*</sup> <sub>c2</sub> (0)	50
表 4.5: 各試料のピン力密度のスケール則におけるγとδ	53
表 4.6: 50 時間試料におけるピンニング・パラメータ	55
表 4.7:100 時間試料におけるピンニング・パラメータ	55

## 第一章

1.1 はじめに

1908年にオランダの K. Onnes はヘリウムの液化に成功した。1911年に液体へ リウムを用いた極低温における水銀の抵抗を調査する過程で 4.2 K で突然電気 抵抗がゼロになることを発見した。電気抵抗ゼロの性質を持つことから、マグネ トへの応用が期待され、水銀線を用いた超伝導マグネットが作製されたが、この 試みは失敗した。これは、当初発見された超伝導体が、わずかな磁界で電気抵抗 ゼロの性質を失ってしまったためであった。この失敗から、超伝導体には、超伝 導現象を示さなくなる臨界面が存在することがわかった。超伝導現象を示さな くなる磁界,温度をそれぞれ上部臨界磁界 $B_{c2}$ 、臨界温度 $T_{c}$ と呼ぶ。また,電気 抵抗0 で電流が流せる最大の電流密度を臨界電流密度」と呼ぶ。その後、実用超 伝導体である Nb<sub>3</sub>Sn は 1954 年に、Bell 研究所の B. T. Matthias らに発見され[1]、 1962 年に T.G. Berlicourt らにより発見された[2]。更に、1986 年に J.G. Bednorz、 K. A. Müller らによって銅酸化物系超伝導体La<sub>2</sub>BaCuO<sub>4</sub>が発見され[3]、 30 K を 超える温度で超伝導が発現する可能性が示された。この発表以降,世界各国で高 温超伝導の探索が続けられ、翌年には液体窒素の沸点である 77.3 K を超える T<sub>c</sub> =93 K のYBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>v</sub>が C.W. Chu らにより発見された[4]。1988 年には、H. Maeda らによってT<sub>c</sub>=100K を超える Bi系の超伝導体が発見されている[5]。このよう な高いTcを持つ超伝導体は高温超伝導体と呼ばれる。これらの超伝導体は液体へ リウムに比べて安価な液体窒素や冷凍機で超伝導状態となるため、様々な機器 への応用の可能性や冷却コストの低減などの点から大きな注目を浴びた。現在 では、石狩市において 500 m 直流超伝導送電に成功する[6]等、電力輸送に関す る高温超伝導体実用のための研究は進んでいる。しかし、超伝導マグネットに関 しては、1.3節に記述する問題から高温超伝導体のマグネット応用に向けての大 きな課題が残っている。

図 1.1 に様々な超伝導材料の臨界面を示す。図中の範囲が広い程、超伝導応用 機器の性能が向上することから、超伝導材料における*B*<sub>c2</sub>、*T*<sub>c</sub>、*J*<sub>c</sub>の向上に関する 研究が続けられている。



図 1.1: 様々な超伝導材料の臨界面[7-9]

#### 1.2 超伝導体の種類

超伝導体には、大まかに金属超伝導体、高温酸化物超伝導体、有機超伝導体、 鉄系超伝導体に分類できる。本研究で用いた Nb<sub>3</sub>Sn は、主にマグネット応用に 用いられる材料である。したがって、超伝導マグネットに用いられる金属超伝導 体と高温酸化物超伝導体に注目して説明を行う。

#### 1.2.1 合金系超伝導体

合金系超伝導体として、最も有名なものは実用超伝導体の Nb-Ti である。Nb-Ti は後述する Nb<sub>3</sub>Sn や高温酸化物超伝導体と比較すると、*B*<sub>c2</sub>、*T*<sub>c</sub>、*J*<sub>c</sub>特性の全 てで劣っている。しかし、他の超伝導体にはない程、線材加工が容易で安価な材 料となっている。また、Nb-Ti の*B*<sub>c2</sub>、*T*<sub>c</sub>特性は、Nb と Ti の混合比と熱処理加工 によって決定される。図 1.2 に 4.2 K における*B*<sub>c2</sub>と*T*<sub>c</sub>と常伝導抵抗率ρ<sub>n</sub>の Ti の 混合比率依存性を示す。この図のように、Ti の混合率により*B*<sub>c2</sub>と*T*<sub>c</sub>が変化する ことから、市販の Nb-Ti では*B*<sub>c2</sub>が最大となる約 60 at%で線材化されている。ま た、400℃付近の熱処理により α-Ti 粒子が析出し、ピンニングセンターが導入さ れ、*J*<sub>c</sub>が顕著に向上した[10]。図 1.3 に 2004 年における超伝導線材の年間製造量 に占める各超伝導体の種類を示す。図 1.3 にあるように、市場を占める Nb-Ti の 割合が非常に高い。この理由としては、前述の Nb-Ti 線材の加工性の良さと、1.3 節に後述する超伝導体のマグネット応用の際に課題となる、超伝導接続の問題 が Nb-Ti では解決されている点がある。主に、Nb-Ti 合金線材は後述する超伝導 マグネットである MRI、国際熱核融合実験炉(ITER)等に用いられている。



図 1.2: 4.2 K における $B_{c2}$ と $T_c$ と常伝導抵抗率 $\rho_n$ の Ti の混合比率依存性[11]



図 1.3: 2004 年における超伝導線材の年間製造量に占める各超伝導体の種類

#### 1.2.2 化合物系超伝導体

化合物系超伝導体の中で、主に研究されているのは A15 型超伝導体である Nb<sub>3</sub>Sn と Nb<sub>3</sub>Al である。

Nb<sub>3</sub>Sn は Nb-Ti と同様に実用超伝導体であり、本研究で用いた材料である。 1.2.1 項で述べた Nb-Ti の $T_c \simeq 9.0 \text{ K}$ 、 $B_{c2}(4.2 \text{ K}) = 11 \text{ T}$ と比較すると、Nb<sub>3</sub>Sn の  $T_c \simeq 17.5 \text{ K}$ 、 $B_{c2}(4.2 \text{ K}) = 20 \text{ T}$ の方が大きく、合金系超伝導体より化合物系超 伝導体の方が超伝導特性に優れている。しかし、合金系超伝導体よりも加工性が 悪く、熱処理温度が 1000°C以上必要で、金属組成比が 3:1 から外れると著しく 超伝導特性が劣化するという問題点がある。この問題点を改善し、Nb<sub>3</sub>Sn を実用 超伝導体にした線材作製法が 1.4.1 項に後述するブロンズ法[12]である。

Nb<sub>3</sub>Al は Nb<sub>3</sub>Sn と比較し、機械的特性、*J*<sub>c</sub>特性、*T*<sub>c</sub>が優れている。1998 年に急 熱急冷・変態法[13]が開発され、Nb<sub>3</sub>Al 線材の長尺化の可能性が広がっている。 図 1.4 に急熱急冷・変態法 Nb<sub>3</sub>Al とブロンズ法 Nb<sub>3</sub>Sn の*J*<sub>c</sub>-*B*特性を比較した結果 を示す。しかし、化学量論比組成の Nb<sub>3</sub>Al にするには最低でも 1700℃以上にす る必要があり、ブロンズ法のような熱処理温度を下げる効果のある線材作製法 が開発されていない。



図 1.4: 急熱急冷・変態法 Nb<sub>3</sub>Al とブロンズ法 Nb<sub>3</sub>Sn のJ<sub>c</sub>-B特性の比較

#### 1.2.3 高温酸化物超伝導体

銅酸化物超伝導体は 1.2.1 項と 1.2.2 項に示す金属超伝導体とは、超伝導現象 の発現のメカニズムが異なる。そのため、金属超伝導体と比較し、T<sub>c</sub>が高い。ま た、高温酸化物超伝導体のT<sub>c</sub>が安価な液体窒素(77.3 K)より温度が高いことから 液体ヘリウムで駆動する金属超伝導体に代わる超伝導体として盛んに研究が進 められている。マグネット応用では、2015 年に物質・材料研究機構で開発され た世界最高磁場約 24 T の NMR(核磁気共鳴)分析器において、高温酸化物超伝導 体である Bi 系超伝導体のテープ線材 BSCCO が用いられた[14]。BSCCO により、 最大磁場は 20.4 T から 24.0 T に増加した。しかし、1.3 節に示す超伝導接続の問 題により、BSCCO と Nb<sub>3</sub>Sn 等における接合は抵抗が発生する半田で接合されて いる。そのため、高温酸化物超伝導体を用いた超伝導マグネットで NMR に求め られる永久電流運転が成功していないのが現状である。しかし、高温酸化物超伝 導体で超伝導接続の技術が確立されると永久電流運転の超伝導マグネットの最 大磁場が 40 T を超えると言われているため、現在も超伝導接続の研究が進めら れている。

#### 1.3 超伝導応用

ここでは、金属超伝導体が主に用いられている超伝導マグネット分野に着目 して説明を行う。

#### 1.3.1 核磁気共鳴分析器(NMR)

NMR は有機材料、タンパク質などの構造解析に製薬分野等で利用されている。 2012 年現在では、国内で約 2000 台の NMR が稼働し、その数は増加している。 NMR の感度は磁場の 1.5 乗に比例することが知られている。また、測定時間の 短縮、無機材料の構造解析が可能となることから、NMR の最大磁場の増加が求 められる。図 1.5 に NMR の最大磁場の推移[15]を示す。NMR の超伝導マグネッ トでは、磁場の強さに水素核の NMR 周波数で表す。約 2.35 T で 100 MHz に対 応する。1975 年、Nb-Ti 線材の実用化により、9.4 T(400 MHz)マグネットが開発 された。1991 年、1.5.1 項に後述する Ti 添加された Nb<sub>3</sub>Sn により 16.5 T(700 MHz) まで最大磁場が増加した。超流動へリウムによる冷却によって 18.8 T(800 MHz) 以上の最大磁場が可能となりました。2015 年に 1.2.3 項にも記述した Bi 系超伝 導線材により約 24 T(1020 MHz)の世界最高磁場の NMR が開発されました。この ように年々NMR の最大磁場は増加している。



図 1.5: NMR の最大磁場の推移[15]

#### 1.3.2 磁気共鳴画像(MRI)

MRIは1.3.1項で記述したNMR分析器と同様に核磁気共鳴を利用するである が、NMR分析器とは使用用途が違い、人体の断面画像を得るためのである。人 体の断面画像を得る方法として、X線CT(Computed Tomography)法がある。この 方法は、X線を用いるため被ばく量の関係から短期間に何度も撮影ができない が、MRIは磁気を用いているため、何度でも撮影ができるメリットがある。MRI は人体における水や脂肪に含まれる水素原子核の密度分布を求めることによっ て、健康な細胞と腫瘍等を判別する。特に、X線CTでは難しい頭部の描出に優 れている。2012年現在では、国内で約6000台が国内で稼働している。現在主流 になっているのは、1.5TのMRIであり、3TのMRIも国内に約300台設置され ている。世界最大磁場を発する MRI はフランスの高磁場 MRI センターにある 11.74TのMRIとなっている。

#### 1.3.3 国際熱核融合実験炉(ITER)

ITER は日本、欧州、ロシア、中国、アメリカ、韓国、インドが連携を行い、 次世代の核融合研究を進めるために開始された計画である。2005 年にフランス のカダラッシュに建設されることが決定し、2035 年に重水素、トリチウム運転 開始する予定である。ITER におけるプラズマの温度は1億から10億℃と言わ れている。プラズマの閉じ込める方法としては、プラズマは磁束線に巻き付く性 質があり、これを利用してプラズマを閉じ込める。核融合炉における超伝導の役 割は、プラズマを閉じ込める壁として、多量の磁束線を発生させることである。 そのため、核融合炉に超伝導技術は欠かせないものとなっている。

図 1.6 に ITER の内部構造を示す。Nb<sub>3</sub>Sn は中心ソレノイドコイル、トロイダル磁場コイル、ポロイダル磁場コイルに使用されている。



図 1.6: ITER の内部構造[16]

#### 1.4 Nb<sub>3</sub>Sn 線材の作製法

Nb<sub>3</sub>Sn 線材には、幾つかの作製法がある。それぞれに長所、短所があるので、 それらについて説明する。

#### 1.4.1 ブロンズ法

ブロンズ法はブロンズ(Cu-Sn)を母材として Nb と反応させ、Nb<sub>3</sub>Sn を作製する 方法である。ブロンズ法の概略図を図 1.7 に示す。ブロンズ法の長所としては、 ブロンズを母材とすることによって、NbSn<sub>2</sub>や Nb<sub>6</sub>Sn<sub>5</sub>等の中間化合物に固溶し、 Nb との反応により生成を助長することにある[17]。また、通常 Nb<sub>3</sub>Sn 作製に必 要な熱処理温度 930 – 950℃を 700℃まで下げることができる。熱処理温度の低 下により、超伝導特性の向上とマグネット応用が可能となった。熱処理温度が上 がるにつれて、結晶粒が粗大化することでピン力F<sub>p</sub>が減衰する。それを抑えるこ とができる。Nb<sub>3</sub>Sn マグネットを作製する際、マグネットで発生した磁界により Nb<sub>3</sub>Sn に力が加わり、超伝導特性が劣化し、マグネットがクエンチを起こすこと がある。それを防ぐために Nb<sub>3</sub>Sn をガラス樹脂等で固定化させる。ガラス樹脂 の耐熱温度が 800℃付近であり、熱処理温度の低下により、Nb<sub>3</sub>Sn をマグネット 応用することができた。

ブロンズ法の短所としては、ブロンズに溶かすことができる Sn 濃度に限界 15.8 wt.%がある。したがって、Nb<sub>3</sub>Sn の生成量に限界が生じる。溶かすことので きる限界のことを固有限と呼ぶ。しかし、固有限は合金作製技術の進歩により 18.5wt.%まで向上している[18]。



図 1.7: ブロンズ法の概略図

#### 1.4.2 内部拡散法

内部拡散法は Sn を Cu マトリックスとしたチューブに配置し、多数の Nb ロッドを配した複合体に熱処理を施すことによって、Nb<sub>3</sub>Sn を作製する方法である [19]。図 1.8 に内部拡散法の概略図を示す[20]。内部拡散法の長所としては、ブロンズ法と比べ線材中の Sn 含有量に加工上の制約がないため、Nb<sub>3</sub>Sn の生成量 が多く*J*<sub>c</sub>特性に優れる点にある。短所としては、ブロンズ法と比較して、線材の 機械的特性が悪いため、Nb<sub>3</sub>Sn 層が割れやすい点にある。この問題を解決するた めに、Cu を Cu-Zn(真鍮)に変えることによって機械的特性を向上させる試みも 行われている[21]。



図 1.8: 内部拡散法の概略図[20]

#### 1.4.3 PIT(Powder in Tube)法

Nb<sub>3</sub>Sn 作製における PIT 法は、NbSn<sub>2</sub>や Nb<sub>6</sub>Sn<sub>5</sub>等の中間化合物粉末を Sn ソ ースとし、Cu の粉末と混ぜたものを Nb チューブに入れ、熱拡散を行うことに よって Nb<sub>3</sub>Sn を生成している。PIT 法は、Nb<sub>3</sub>Sn 以外にも高温酸化物超伝導体で ある Bi 系超伝導体や MgB<sub>2</sub> 作製にも用いられている。PIT 法の長所としては、 他の作製法と比較して、作製が容易な点にある。一方、短所としては、ブロンズ 法で作製したものと比較して結晶粒が大きく、機械的特性が悪い点にある。

#### 1.5 元素添加効果

Nb<sub>3</sub>Sn にチタン(Ti)添加を行うことによって、Nb<sub>3</sub>Sn の結晶成長を促進させる[22]。また、添加により $J_c \ge B_{c2}$ が向上することも知られている[23]。そのため、 1.3 節に示す NMR 等には Ti 添加された Nb<sub>3</sub>Sn が用いられている。それぞれ、添 加効果について以下で説明する。

#### 1.5.1 Nb<sub>3</sub>Sn 層成長に及ぼす影響

元素添加することで、Nb<sub>3</sub>Sn 層への固溶に伴った空格子点が増加し、Sn の格 子拡散係数を増大し、Nb<sub>3</sub>Sn の結晶成長を促進する。Ti 以外にもハフニウム(Hf) 添加でも、同様の効果が確認されている[24]。図 1.9 に様々な元素を添加した試 料の Nb<sub>3</sub>Sn 層の熱処理時間依存性を示す。Hf 添加試料において、Nb<sub>3</sub>Sn の結晶 成長が促進されていることがわかる。図中における添加量は at%である。



図 1.9: 様々な元素を添加した試料の Nb<sub>3</sub>Sn 層の熱処理時間依存性[24]

### 1.5.2 臨界電流密度Jcに及ぼす影響

添加効果により、結晶粒が微細化し、ピンカ密度 $F_p$ が増加することが知られている。図 1.10(a), (b)に無添加と Ti 添加された(Nb-4at%Ti)Nb<sub>3</sub>Sn 試料における結晶粒を示す[21]。また、図 1.11 に無添加と Ti 添加された(Nb-4at%Ti)Nb<sub>3</sub>Sn 試料における $J_c$ -B特性を示す。図 1.11 における Pure Nb Core、Nb-4at%Ti がそれぞれ図 1.10 中における無添加試料、Ti 添加試料を表す。図 1.10 における Nb<sub>3</sub>Sn は、本研究とは違い Nb 側に Ti を添加している。図 1.10 – 1.11 より、無添加試料と比べ Ti 添加された試料は結晶粒も小さく $J_c$ も高いことがわかる。



図 1.10(a): 無添加 Nb<sub>3</sub>Sn 試料における結晶粒[21]



図 1.10(b): Ti 添加された Nb<sub>3</sub>Sn 試料(Nb-4at%)における結晶粒[21]



図 1.11: 無添加と Ti 添加された(Nb-4at%Ti)Nb<sub>3</sub>Sn 試料におけるJ<sub>c</sub>-B特性

#### 1.5.3 上部臨界磁界B<sub>c2</sub>に及ぼす影響

元素添加効果により、電子の平均自由行程lが減少し、電子のコヒーレンス長  $\xi$ が縮小する。このコヒーレンス長の縮小により $B_{c2}$ が向上することが知られて いる。以下で簡単に説明する。

電子の平均自由行程*l*と電子のコヒーレンス長*ξ*の関係式は(1.1)式のようになる。

$$\xi^{-1} = \xi_0^{-1} + l^{-1} \tag{1.1}$$

ここで、**ξ0**は物質本来の電子の平均自由行程を表す。この式より、電子のコヒー レンス長**ξ**は電子の平均自由行程**1**に依存することがわかる。

また、 $B_{c2}$ と $\xi$ の関係式を(1.2)式に示す。

$$B_{c2} = \frac{\varphi_0}{\pi \xi^2} \tag{1.2}$$

ここで、 $\varphi_0$ は量子化磁束を表す。(1.2)式より、 $\xi$ が減少すると共に、 $B_{c2}$ が増加することがわかる。

#### 1.6 WHH 理論

WHH(Werthamer-Helfand-Hohenberg)理論は、スピン軌道散乱効果とパウリ常磁性効果の効果を取り入れ、 $B_{c2}$ の温度依存性を記述した理論である[25]。WHH 理論における以下の式を用いて、低温領域の $B_{c2}$ の推定が行われている。

$$B_{c2}(0 \text{ K}) = 0.693 \times T_{c} \left| \frac{\mathrm{d}B_{c2}}{\mathrm{d}T} \right|_{T=T_{c}}$$
 (1.3)

また、 $B_{c2}$ の温度依存性を(1.4)式に示す。

$$B_{c2}(T) = B_{c2}(0 \text{ K}) \left[ 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right) \right]^n$$
(1.4)

(1.3)式中における 0.693 は(1.4)式のB<sub>c2</sub>の温度依存性の両辺を用いて、以下のようにして求められる。

$$B_{c2}(T) = B_{c2}(0 \text{ K}) \left[ 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right) \right]^n$$
$$\frac{dB_{c2}(T)}{dT} = -\frac{n}{T_c} B_{c2}(0 \text{ K}) \left(\frac{T}{T_c}\right)^{n-1}$$
$$\left| \frac{dB_{c2}}{dT} \right|_{T=T_c} = -\frac{n}{T_c} B_{c2}(0 \text{ K}) \left(\frac{T_c}{T_c}\right)^{n-1}$$
$$B_{c2}(0 \text{ K}) = -\frac{1}{n} \left| T_c \cdot \frac{dB_{c2}}{dT} \right|_{T=T_c}$$

*n* = −1.44のとき、0.693となる。

1.7 磁束クリープ・フローモデル

磁束クリープ・フローモデルは試料内のピン力の分布や、超伝導層の厚さの影響などを定量的に評価できる。*J*c特性の改善を考えるためには、ピン力の分布を 考慮する必要がある。

#### 1.7.1 磁束クリープ

超伝導体に磁界を印加すると磁束線はピンニングセンターによってピン止め される。このピン止めされた磁束線が熱振動によって、ある確率でピンニング・ ポテンシャルから外れてしまう運動のことを磁束クリープという。この現象は 超伝導による永久電流の緩和の際に顕著となる。理論的には超伝導体に流れる 電流は外的な力が加わらない限り永久に流れるはずであるだが、実際に長期に わたって観察していくと外部環境が一定の状態であるにも関わらず、遮蔽電流 が減衰していく。このことにより、ピンニングに基づく超伝導電流が真の永久電 流ではないことを示している。また、この現象は高温になると熱活性化運動が盛 んになるため電流の減衰が顕著になる。よって、高温超伝導体の場合では臨界電 流密度Jcがゼロになってしまうようなことが起こる。

この磁束クリープで磁束線が移動しようとする場合、磁束線は集団で移動す る。この磁束線の集団のことを磁束バンドルと呼ぶ。

電流が流れている超伝導体を仮定すると、磁束バンドルが Lorentz 力によって 受けるエネルギー状態の変位は図 1.12 のようになる。



図 1.12: 磁束バンドルとエネルギーの関係

ただし、磁東バンドルは右向きの Lorentz 力を受けていると仮定する。エネルギ ーが右下がりになっているのは Lorentz 力の影響を考慮しているためである。磁 東バンドルはエネルギーの壁によってピン止めされている状態であり、磁東バ ンドルが移動するためには活性化エネルギーUを超える必要がある。

磁東バンドルは温度Tにおいて、熱エネルギー $k_{\rm B}T$  ( $k_{\rm B}$ は Boltzman 定数) により、ある確率で活性化エネルギーUを越える。この確率は Arrhenius の式  $\exp(-U/k_{\rm B}T)$  で与えられる。また、磁東バンドルが磁束クリープによってUを 越えた時の移動距離は磁束線格子間隔 $a_{\rm f}$ であると予想されるため、熱振動周波数  $\epsilon v_0$ として、Lorentz 力と同じ方向を+とすると、生じる磁束バンドルの平均移動 速度 $v_+$ は

$$v_{+} = a_{\rm f} v_0 \exp\left(-\frac{U}{k_{\rm B}T}\right) \tag{1.5}$$

と表される。また、voとafはそれぞれ

$$\nu_0 = \frac{\zeta \rho_f J_{c0}}{2\pi a_f B} \tag{1.6}$$

$$a_{\rm f} = \left(\frac{2\phi_0}{\sqrt{3}B}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{1.7}$$

 $\zeta$ はピン形状に依存する定数であり、点状ピンの場合 $\zeta \cong 2\pi$ 、ピンのサイズが  $a_f$ 以上の非超伝導粒子の場合  $\zeta = 4$  であることが知られている。 $\rho_f$ はフロー比抵 抗であり、 $J_{c0}$ は磁束クリープの影響がない仮想的な臨界電流密度を表す。 $J_{c0}$ は 経験的に

$$J_{c0} = A \left[ 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2 \right]^m B^{\gamma - 1} \left( 1 - \frac{B}{B_{c2}} \right)^2$$
(1.8)

と表せる。A、m、 $\gamma$ はピンニング・パラメータである。

磁東バンドルが左向きに移動する確率を $exp(-U'/k_BT)$ とするとき、全体としての平均の移動速度は

$$\nu = a_{\rm f} \nu_0 \left[ \exp\left(-\frac{U}{k_{\rm B}T}\right) - \exp\left(-\frac{U'}{k_{\rm B}T}\right) \right]$$
(1.9)

で与えられる。

この動きによって生じる電界の大きさは  $E = B \times v$  の関係から

$$E = Ba_{\rm f}v_0 \left[ \exp\left(-\frac{U}{k_{\rm B}T}\right) - \exp\left(-\frac{U'}{k_{\rm B}T}\right) \right]$$
(1.10)

となる。

磁束バンドルの位置xによるエネルギーの変化は

$$F(x) = \frac{U_0}{2}\sin(kx) - fx$$
 (1.11)

で与えられ、 $k=2\pi/a_f$ は波数、f=JBVは磁東バンドルに働く Lorentz 力を表す。 また $U_0$ はピンポテンシャルエネルギーであり、 $U_0/2$ はポテンシャルの振幅を表 す。磁東バンドルが平衡位置にあるときを $x=-x_0$ とすると、 $x=x_0$ のときにエ ネルギーが極大となる。

それぞれの位置でのエネルギー変化率は0となるので

$$x_0 = \frac{a_{\rm f}}{2\pi} \cos^{-1} \left( \frac{f a_{\rm f}}{U_0 \pi} \right)$$
(1.12)

となる。Uは $F(x_0) - F(-x_0)$ から求めることができ、

$$U = U_0 \sin\left[\cos^{-1}\left(\frac{fa_{\rm f}}{U_0\pi}\right) - \frac{fa_{\rm f}}{\pi}\cos^{-1}\left(\frac{fa_{\rm f}}{U_0\pi}\right)\right]$$
$$= U_0 \left[\left\{1 - \left(\frac{2f}{U_0\pi}\right)^2\right\}^{\frac{1}{2}} - \frac{2f}{U_0k}\cos^{-1}\left(\frac{2f}{U_0k}\right)\right]$$
(1.13)

で表される。ここで  $sin(cos^{-1}x) = \sqrt{1-x^2}$ を用いた。このとき熱振動がないとするならばU = 0となり理想的な臨界状態が考えられる。そのためには  $2f/U_0k = 2J_{co}BV/U_0k = 1$ となり、 $J = J_{co}$ となるため

$$\frac{2f}{U_0k} = \frac{J}{J_{c0}} = j \tag{1.14}$$

の関係が導かれる。jは規格化電流密度である。これより(1.9)式は

$$U(j) = U_0 \left[ (1 - j^2)^{\frac{1}{2}} - j \cos^{-1} j \right]$$
(1.15)

となる。さらに  $k = 2\pi/a_f$ 及び(1.12)式から

$$U'(j) \cong U + fa_{\rm f} = U + \pi U_0 j$$
 (1.16)

となる。これより(1.10)式の磁束クリープにより発生する電界を整理すると

$$E = Ba_{\rm f} v_0 \exp\left(-\frac{U(j)}{k_{\rm B}T}\right) \left[1 - \exp\left(-\frac{\pi U_0 j}{k_{\rm B}T}\right)\right]$$
(1.17)

となる。

#### 1.7.2 磁束フロー

磁束クリープの状態からさらに電流を流していくと、やがてピンニング力が Lorentz 力を支えることができなくなり、すべての磁束線が連続的に動き出す。 これを磁束フローと呼ぶ。

磁東フローにより発生する電界を求めるため、ここより磁東クリープの影響 がない状態を仮定する。Lorentz 力の方向の単位ベクトルを  $\delta = v/|v|$  とすると、 磁束線と Lorentz 力の釣り合いの式は

$$\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B} - \boldsymbol{\delta} F_{\rm p0} = 0 \tag{1.18}$$

となる。ただし $F_{p0}$ は磁束クリープの影響がない仮想的なピンニング密度である。 このとき  $J = F_p/B = J_{c0}$ の関係が得られる。この後電流が増加し  $J > J_{c0}$ となる と磁束フロー状態となる。磁束フロー状態では粘性力を考慮して

$$\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B} - \boldsymbol{\delta} F_{\rm p} - \frac{B}{\phi_0} \eta \boldsymbol{\nu} = 0 \tag{1.19}$$

が与えられる。 $\phi_0$ は量子化磁束、 $\eta$ は粘性係数を示す。これを $J_{co} = F_p/B$ 及び $E = B \times v$ を用いて解くと、

$$E = \rho_{\rm f} (J - J_{\rm c0}) \tag{1.20}$$

が導かれ、磁束フローによる電界が求まる。

1.7.3 ピンポテンシャル

ピンポテンシャルエネルギー $U_0$ は磁束線の単位面積当たりの平均化したピンポ テンシャル $\hat{U}_0$ と磁束バンドルの体積Vを用いて

$$U_0 = \hat{U}_0 V$$
 (1.22)  
で表される。この $\hat{U}_0$ は Labusch パラメータ $\alpha_L$ と相互作用距離 $d_i$ を用いて

$$\widehat{U}_0 = \frac{1}{2} \alpha_{\rm L} d_{\rm i}^2 \tag{1.23}$$

と表され、ピン力密度 $F_p$ と

$$F_{\rm p} = J_{\rm c0}B$$
$$= \alpha_{\rm L}d_{\rm i} \tag{1.24}$$

の関係がある。ここで $d_i$ はピン形状に依存する定数  $\zeta$  と格子間隔 $a_f$ に

$$d_{\rm i} = \frac{a_{\rm f}}{\zeta} \tag{1.25}$$

の関係があることから、(1.20) 式を用いて(1.19) 式は

$$U_0 = \frac{1}{2\zeta} J_{c0} B a_{\rm f} V \tag{1.26}$$

と表される。 $a_{\rm f}$ は三角格子の場合、 $\phi_0$ を用いて  $a_{\rm f} = (2\phi_0/\sqrt{3}{\rm B})^{1/2}$ となる。

磁東バンドルを図 1.13(a)、(b)に示すモデルで考える。横方向のピンニング相 関距離Rは格子間隔a<sub>f</sub> 程度かその数倍であると考えられており

$$R = ga_{\rm f} \tag{1.27}$$

で表される。g<sup>2</sup> は磁束バンドル中の磁束線の本数を示す。縦方向のピンニング 相関距離Lは弾性理論から

$$L = \left(\frac{C_{44}}{\alpha_{\rm L}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{Ba_{\rm f}}{\zeta\mu_0 J_{\rm c0}}\right)^{\frac{1}{2}}$$
(1.28)

となる。 $C_{44} = B^2/\mu_0$  は磁束線の曲げ歪みに対する弾性定数である。このLは超 伝導層が薄い場合には、その厚さdに制限されることがある。したがって、超伝 導層の大きさが $U_0$ の大きさに影響を与え、dがLより大きい 3 次元ピンニングの とき、 $V = R^2L$ となり、

$$U_0 = \frac{0.835g^2 k_{\rm B} J_{\rm c0}^{\frac{1}{2}}}{\zeta^{\frac{3}{2}} B^{\frac{1}{4}}}$$
(1.29)

が求められる。d がLより小さい2 次元ピンニングとき、 $V = R^2 d$  となり、

$$U_0 = \frac{4.23g^2 k_{\rm B} J_{\rm c0} d}{\zeta B^{\frac{1}{2}}} \tag{1.30}$$

が求められる。



L > d

図 1.13(a): L > dの場合の磁束バンドルの模式図



図 1.13(b): L < dの場合の磁束バンドルの模式図

1.7.4 磁束クリープ・フローモデル

これまで述べたように、超伝導体には磁束クリープと磁束フローの影響により電界が発生する。これらの電界を考慮し、超伝導体に発生する全体での電界を理論的に求めるモデルが磁束クリープ・フローモデル[26]である。1.7.1 節、1.7.2 節より、磁束クリープによる電界を*E*<sub>cf</sub>、磁束クリープによる電界を*E*<sub>ff</sub>とするとき、これらの寄与からなる電界*E*'は

$$E' = \left(E_{\rm cr}^2 + E_{\rm ff}^2\right)^{\frac{1}{2}} \tag{1.31}$$

となる。

酸化物超伝導体は超伝導体内の不均一さが著しいため、ピンカ密度が広く分 布されると考えられる。そこでピンカの強さを表すピンニング・パラメータAの 分布を

$$f(A) = K \exp\left[-\frac{(\log A - \log A_{\rm m})^2}{2\sigma^2}\right]$$
(1.32)

と表す。Kは規格化定数、 $\sigma^2$ は分布幅を表すピンニング・パラメータを示し、 $A_m$ はAの最頻値である。これより全電界は

$$E(J) = \int_0^\infty E' f(A) \mathrm{d}A \tag{1.33}$$

となり、理論的なE-J特性が求められ、E-J特性を評価することが可能となる。

#### 1.8 臨界電流密度*J* の向上の要因

 $B_{c2}$ は結晶構造に起因して特性が決定するため、1.2.3 項に示す高温酸化物超 伝導体において $J_c$ の向上のために主に行われている人工ピン導入では、 $B_{c2}$ は変 化しない。しかし、金属超伝導体における元素添加では結晶構造が変化するた め、 $B_{c2}$ も変化する。また、図 1.14(a),(b)に、結晶粒微細化による $J_c$ の向上と $B_{c2}$ の変化による $J_c$ の向上の模式図を示す。図 1.14(a),(b)より、結晶粒微細化による  $J_c$ の向上と $B_{c2}$ の変化による $J_c$ の向上は、 $J_c$ の向上の仕方が違うことがわかる。

この Nb<sub>3</sub>Sn への元素添加により(1.8)式に示す仮想的な臨界電流密度の式のピンニング・パラメータであるA、m、 $\gamma$ は結晶粒微細化により変化し、 $J_c$ を向上させる。一方、元素添加により $B_{c2}$ の変化することで、(1.8)式の $B_{c2}$ が変化することで $J_c$ は変化する。

よって、元素添加による*J*<sub>c</sub>の変化に対してピンニング・パラメータと*B*<sub>c2</sub>の変化のどちらが支配的かを明らかにするのは容易ではない。



図 1.14(a): 結晶粒微細化によるJcの向上の模式図



図 1.14(b): Bc2の変化によるJcの向上の模式図

#### 1.9 目的

1954 年に発見された Nb<sub>3</sub>Sn は、国際熱核融合実験炉: ITER 計画におけるトロ イダル磁場コイル、中心ソレノイドコイル、核磁気共鳴分析器(NMR)等の高磁界 マグネット等に用いられる優れた超伝導材料である。特に、Nb3Snの上部臨界磁 界Bc2はNb-Tiに比べて2倍以上も高いことから様々な分野への利用が期待され、 更なる臨界電流密度J。特性向上が求められる。この Nb3Sn 線材の作製法には様々 な手法があり、その中でもブロンズ法は高磁界で高い」。特性が得られる。この手 法のブロンズへの少量のチタン(Ti)添加は、Nb3Sn 層への固溶に伴った空格子点 の増加により Sn の格子拡散係数を増大させ、結果的に Nb3Sn の結晶成長を促進 させる。同様な効果はハフニウム(Hf)でも報告されている。更にこの添加は結晶 粒の微細化による結晶粒界面の増加と、コヒーレンス長が短くなる効果から、L とBc2が向上する。同様に、タンタル(Ta)、ガリウム(Ga)添加によるBc2の増加、 ジルコニウム(Zr)、マグネシウム(Mg)、ゲルマニウム(Ge)添加によるJcの増加が 知られている。よって、このような元素添加が Nb<sub>3</sub>Sn の新しい作製手法や特性 向上に有効に働く可能性がある。ただし、様々な元素添加やその組み合わせに関 した調査は十分でない。したがって、高特性を有する Nb<sub>3</sub>Sn 材料の開発のため には、どのような元素及び組み合わせがどの特性に有効なのかを明らかにする 必要がある。

以上の背景から、本研究では初期の試みとして Ti 添加された Nb<sub>3</sub>Sn 用ブロンズ(組成: Cu-15Sn-0.3mass%Ti)に、さらに第四元素として Mg, Ga, Ge, Hf, Ta を添加し、高磁界応用で重要な特性である $B_{c2}$ と $J_c$ 特性へどのような影響を与えるかについて調べた。

### 第二章 実験方法と試料の諸元

#### 試料の諸元 2.1

今回実験に用いた Nb<sub>3</sub>Sn は、株式会社大阪合金工業所によって作製された。 作製法は、1.4.1 項に示すブロンズ法である。Ti(チタン)添加された Nb<sub>3</sub>Sn(Cu-15 mass%Sn-0.3 mass%Ti)を出発材料とし、第四元素として Mg(マグネシウム)、Ga(ガ リウム)、Ge(ゲルマニウム)、Hf(ハフニウム)、Ta(タンタル)を添加した。また、 700℃の熱処理を 50 h, 100 h の 2 パターンで行った。試料名は、添加された第四 元素-熱処理時間で表す。例えば、第四元素として Mg を添加した熱処理時間が 50 h の試料は、Mg-50 と表す。また、Ti だけ添加した試料は ST で表す。表 2.1 に試料名と元素添加量を示す。

#### 試料の断面観察 2.2

試料の断面観察、Nb3Sn 層の厚さの評価は、株式会社大阪合金工業所において EMPA(電子プローブマイクロアナライザー)を用いて行われた。各試料における 試料サイズを表 2.2 に示す。また、各試料における試料断面を図 2.1 – 2.12、 Nb<sub>3</sub>Sn 層の断面を図 2.13-2.24 に示す。図中における黒の部分が銅、二つの薄い 灰色の層がニオブ、上部のニオブ層の下部と下部のニオブ層の上部にある白い 薄い層が Nb<sub>3</sub>Sn 層、二つのニオブ層に挟まれている濃い灰色の層がブロンズと なっている。一部の試料で Nb<sub>3</sub>Sn 層が割れているが、これは EPMA による測定 前に試料を機械研磨した際に割れたと考えられる。

表 2.1: 試料名と元素添加量									
Composition (m	Composition (mass%)		100 h						
		ST-50	ST-100						
	+0.50 Mg	Mg-50	Mg-100						
$C_{11}$ 158 $m$ 0.2 Ti	+0.50 Hf	Hf-50	Hf-100						
Cu-15511-0.511	+0.05 Ge	Ge-50	Ge-100						
	+5.00 Ga	Ga-50	Ga-100						
	+0.08 Ta	Ta-50	Ta-100						

	~	60 11018				
	ST-50	Mg-50	Hf-50	Ge-50	Ga-50	Ta-50
Length[mm]	4.90	4.70	4.30	4.60	4.40	4.20
Width[mm]	2.50	3.30	3.50	2.90	3.50	3.30
Sample thickness[mm]	0.410	0.196	0.246	0.194	0.238	0.319
Nb₃Sn layer Thickness [µm]	21.3	17.5	16.3.	8.78	7.76	18.8

表 2.2:50 時間試料の試料サイズ

表	2.3:	100	時間試料の試料サイ	ズ
---	------	-----	-----------	---

	ST-100	Mg-100	Hf-100	Ge-100	Ga-100	Ta-100	
Length[mm]	4.70	4.50	3.40	4.60	4.20	4.55	
Width[mm]	2.40	3.30	3.20	2.90	3.30	3.30	
Sample thickness[mm]	0.413	0.247	0.254	0.365	0.235	0.385	
Nb₃Sn layer Thickness [μm]	2.68	22.1	24.4	27.2	14.7	30.8	



図 2.1: ST-50 における試料断面



図 2.2: Mg-50 における試料断面



図 2.3: Hf-50 における試料断面





図 2.5: Ga-50 における試料断面



図 2.6: Ta-50 における試料断面



図 2.7: ST-100 における試料断面



図 2.8: Mg-100 における試料断面



図 2.9: Hf-100 における試料断面



図 2.10: Ge-100 における試料断面



図 2.11: Ga-100 における試料断面



図 2.12: Ta-100 における試料断面



図 2.13: ST-50 における Nb<sub>3</sub>Sn 層断面



図 2.14: Mg-50 における Nb<sub>3</sub>Sn 層断面



図 2.15: Hf-50 における Nb<sub>3</sub>Sn 層断面



図 2.16: Ge-50 における Nb<sub>3</sub>Sn 層断面



図 2.17: Ga-50 における Nb<sub>3</sub>Sn 層断面



図 2.18: Ta-50 における Nb<sub>3</sub>Sn 層断面



図 2.19: ST-100 における Nb<sub>3</sub>Sn 層断面



図 2.20: Mg-100 における Nb<sub>3</sub>Sn 層断面



図 2.21: Hf-100 における Nb<sub>3</sub>Sn 層断面



図 2.22: Ge-100 における Nb<sub>3</sub>Sn 層断面



図 2.23: Ga-100 における Nb<sub>3</sub>Sn 層断面



図 2.24: Ta-100 における Nb<sub>3</sub>Sn 層断面

#### 2.3 測定方法

今回の実験では、第四元素添加により、 $J_c$ 、 $T_c$ 、 $B_{c2}$ が変化している可能性があった。したがって、測定では、4.2-14Kにおける直流磁化測定の結果から、各温度における $J_c$ -B特性を求めた。また、 $T_c$ 近傍における直流磁化率の温度依存性から $B_{c2}$ -T特性を求めた。各試料における $J_c$ の向上には、 $F_p \ge B_{c2}$ の変化のどちらが支配的かについて磁束クリープ・フローモデルを用いて調査するために、6-14Kにおける磁化緩和測定を行い、その結果から各温度におけるE-J(電界-電流密度)特性を求めた。測定には SQUID 磁力計(MPMS7)を用いた。

#### 2.3.1 臨界電流密度J<sub>c</sub>の測定

超伝導体の磁気ヒステリシスループの例を図 2.25 に示す。直流磁化測定においては、図 2.25 中の赤線に示す初期磁化の影響をなくすために測定前に-2 T 印加した。また、J<sub>c</sub>は磁気ヒステリシス曲線におけるヒステリシスの幅Δmを以下の式に代入することにより求めた。

$$J_{\rm c} = \frac{6}{w^2(3l - w)d}\Delta m \tag{2.1}$$

ここで、l, w(l > w), d は試料の長さ、幅、厚さである。

ここで、(2.1)式の導出を行う。長さ*l*、幅*w*(*l* > *w*)の平板状超伝導体の広い面に 垂直に磁界を加えた場合について考える。試料に座標を設け、試料の幅方向、長 さ方向、厚さ方向を軸とし、試料の中心を原点とする。四方向から試料へ磁束が



侵入し、これを遮蔽する電流は、臨界電流密度が等方的ならば、Bean モデル(ピンカ密度が磁束密度に比例する、つまり臨界電流密度が磁束密度に対して一定であると仮定した場合の第二種超伝導体内部の磁束分布モデル)を仮定すると図 2.26 の斜線部分を流れる環状電流となる。この微小幅dxに流れる微小電流d $I_c$ をとする。この細い電流路のz軸方向のサイズをdzとするとd $I_c = J_c dx dz$ である。さらに幅dxの帯に囲まれた領域の面積をSとすると、Sはxのみの関数と表すことができ、

$$S = 4x \left( x + \frac{l-w}{2} \right)$$
  
= 4x<sup>2</sup> + 2x(l-y) (2.2)

となる。

また、この微小電流によって発生する磁気モーメントは $dm = SdJ_c$ となる。したがって、発生する磁気モーメントは

$$m = \iint S(x)J_{c} dxdz$$

$$= J_{c}d \int S(x) dx$$
(2.3)

となる。ここで、dは超伝導体の厚みである。これを計算すると

$$m = \frac{J_{\rm c} w^2 (3l - w)d}{12} \tag{2.4}$$

となる。

図 2.26 における磁束密度の空間分布は、下部が外部磁界の増磁過程、上部が減磁過程を表す。

また、図 2.25 をc軸方向正から俯瞰した図が図 2.26 である。電流のループと微小幅dxの範囲に帯に囲まれた領域を図に示す。

したがって、(2.3)式,  $\Delta m = m/2$ を用いて、

$$\Delta m = \frac{J_{\rm c} w^2 (3l - w)d}{6}$$
(2.5)

これを変形すると(2.1)式となる。

図 2.28 に磁気モーメントの磁界特性(*m-B*特性)の例を示す。ここで、図中にお ける白抜き丸が理論値、黒塗り丸が実験値である。一部の結果でフラックスジ ャンプが発生したため、多項式近似を用いて、フラックスジャンプが発生して いない場合の*m-B*特性を推定した。推定した*m-B*特性と(2.1)式を用いて、 $J_c$ -B特 性を求めた。ここで、電界基準は $1.0 \times 10^{-9}$  V/mとした。



図 2.26 磁束線が侵入した場合の磁束密度の空間分布



図 2.28 磁気モーメントの磁界特性(m-B特性)の例

#### 2.3.2 上部臨界磁界*B*<sub>c2</sub>の評価

図 2.29 に示すように、 $B_{c2}$ の温度特性を調べるために、温度が $T_c$ 以下の状態で 磁場を一様に印加した状態(ゼロ磁界中冷却)から温度を $T_c$ 以上まで徐々に変化 させ、温度が $T_c$ 以上の状態で磁場を一様に印加し、 $T_c$ 以下まで温度下げた状態 (磁界中冷却)において、そのときの磁気モーメントmを測定した。このとき得ら れたm-T特性において、ゼロ磁界中冷却と磁界中冷却の磁気モーメントの差  $\Delta m'$ としたとき、この $\Delta m'$ が1.0 × 10<sup>-9</sup> A・m<sup>2</sup>となるTの値を $T_c$ とした。図 2.30 に $\Delta m'$ の温度依存性を示す。



図 2.29: 磁気モーメントの温度特性(m-T特性)の例



#### 2.3.3 電界-電流密度(E-I)特性の評価

T<sub>c</sub>以下の状態で磁場を印加し、時間と共に減衰する磁気モーメントを測定した。 これを磁化緩和測定といい、その例を図 2.31 に示す。磁化緩和測定には、磁場の印加の仕方が 2 種類ある。

- (a) 試料に対して十分大きな磁場を印加して、目的の磁場まで下げて、試料内部 に磁束を十分トラップさせる方法。
- (b) 十分大きな磁場を印加することなく、目的磁場を印加し試料内部に磁束を侵入させる方法。

今回は、(a)で測定を行った。試料内部に磁束を印加したとき、内部の磁束を保 っために、一定の遮蔽電流を流そうとする。しかし、時間に対して対数的に遮蔽 電流の減衰が発生し、このときの遮蔽電流は磁化から求めることができる。以上 より、磁化の緩和測定からE-J特性が得られる。Jは(2.6)式により求めた。

$$J = \frac{6(m - m^*)}{w^2(3l - w)d}$$
(2.6)

ここで、*m*\*は磁気ヒステリシスより求めた磁化補正値である。*E*は(2.7)式により求めた。

$$E = -\frac{\mu_0 G}{2d(l+w)} \cdot \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} \tag{2.7}$$

ここで、l、w(l > w)、d、 $m^*$ 、Gは試料の長さ、幅、厚さ、磁気モーメント、電 界補正値である。電界補正値は試料サイズの積分により求めた。



### 第三章 実験結果

#### 3.1 *J<sub>c</sub>-B*特性

各試料における、4.2 - 14 K における直流磁化測定の結果から、 $J_c$ -B特性を求めた。各試料における $J_c$ -B特性の結果を図 3.1 - 3.12 に示す。全ての元素添加において、熱処理時間が長い試料の方が $J_c$ の値が高い傾向にあった。また、50時間試料、100時間試料のどちらにおいても、Ga 添加試料の $J_c$ が一番低い結果となった。50時間試料においては、 $J_c$ の値は Mg-50 で一番大きく、100時間試料においては、 $J_c$ の値は Hf-100 で一番大きくなった。各試料において、 $J_c$ が変化しているため第四元素添加により $F_p$ または $B_{c2}$ が変化することがわかった。各試料における $J_c$ は、ピンニング特性または $B_{c2}$ の変化のどちらにより決定されているかについての議論は 4.3 節、4.4 節において述べる。















図 3.8: Mg-100 におけるJ<sub>c</sub>-B特性







図 3.11: Ga-100 における**J**c-B特性

図 3.12: Ta-100 における*J*c-B特性

#### 3.2 B<sub>c2</sub>-T特性

一定磁界 $B = 1.0 \times 10^{-3}$ ,1,3,5,7 Tでのゼロ磁界中冷却と磁界中冷却の磁気モ ーメントの差が 1.0 × 10<sup>-9</sup> A・m<sup>2</sup>となるときのB- $T_c$ 特性を $B_{c2}$ -T特性とした。50 時間試料、100時間試料における $B_{c2}$ -T特性を図 3.13 – 3.14 に示す。また、 $B = 0(1.0 \times 10^{-3})$ ,1,3,5,7 Tでの各試料の $T_c$ を表 3.1 – 3.2 に示す。熱処理時間が長い 試料の方が、 $B_{c2}$ が高い傾向にある。各試料における $B_{c2}$ の変化の比較は、4.2 節 で行う。



			$T_{\rm c}$			
<i>B</i> [T]	ST-50	Mg-50	Hf-50	Ge-50	Ga-50	Ta-50
0	17.1	17.1	16.7	16.9	17.4	17.0
1	16.1	16.2	16.2	15.7	15.8	15.9
3	14.7	15.0	14.9	14.4	14.4	14.8
5	13.7	14.0	13.7	13.7	13.3	13.7
7	12.6	13.0	12.8	12.2	11.8	12.7

表 3.1:50 時間試料におけるBc2-T特性

表 3.2:100 時間試料におけるB<sub>c2</sub>-T特性

			$T_{\rm c}$			
<i>B</i> [T]	ST-100	Mg-100	Hf-100	Ge-100	Ga-100	Ta-100
0	17.8	17.9	17.4	17.6	18.1	17.8
1	17.0	17.0	16.7	16.8	17.1	16.8
3	15.7	15.9	15.7	15.6	15.8	15.7
5	14.7	14.9	14.8	14.6	14.6	14.9
7	13.7	13.9	14.0	13.5	13.5	14.0

#### 3.3 *E-J*特性

各試料における磁化緩和測定から得られた*E-J*特性の測定結果を図 3.15 – 3.26 に示す。これらの *E-J*特性を基に磁束クリープ・フローモデルを用いて、ピンニ ング・パラメータを求めた。その結果から、各試料における*J*cは、*F*pまたは*B*c2の 変化のどちらにより決定されているかについて調べた。その結果は 4.4 節に示 す。







### 第四章 解析及び考察

#### 4.1 Nb<sub>3</sub>Sn 層の熱処理時間依存性

1.6.1 項に示すように、添加の有無関係なしに Nb<sub>3</sub>Sn 層の厚さと熱処理時間は 直線関係が得られることが知られている。Nb<sub>3</sub>Sn 層の厚さ*l*は熱処理時間*t*に対し て以下の関係で表される。

$$l = kt^m \tag{4.1}$$

ここで、kは比例定数、mは時間の指数を表す。

図 4.1 に 700℃における添加元素別の熱処理時間依存性の結果を示す。図中に おける線は(4.1)式で近似した線である。このとき、各試料における時間の指数*m* の結果を表 4.1 に示す。しかし、表 2.2-2.3 に示すように試料サイズが各試料で 違う。したがって、Nb<sub>3</sub>Sn 層の熱処理時間依存性の評価を行うため、Nb<sub>3</sub>Sn 層の 厚さを試料の厚さで割った値を*l*\*として評価に用いた。

図 4.1 と表 4.1 から、第四元素添加により Nb<sub>3</sub>Sn 層の熱処理時間依存性が変化 していることがわかる。mが大きいほど、Nb<sub>3</sub>Sn 層の厚さが熱処理時間の増加と 共に大きく増加していることになる。Ga 添加試料において、m = 0.944となり、 今回の試料の中では最大の値となった。また、Mg 添加試料において、m = 0.008となり、今回の試料の中では最低の値となった。Ga 添加試料に着目すると、 $l^*$ は 50 時間試料、100 時間試料のどちらでも一番小さい。Mg 添加試料では、50 時 間試料、100 時間試料では $l^*$ の値はほとんど変化していない。しかし、 $l^*$ の値は 50 時間試料では一番大きく、100 時間試料では二番目に大きい結果となった。Ti と同様に、添加により Nb<sub>3</sub>Sn 層の熱処理時間依存性が向上することが知られて いる Hf 添加試料に着目すると、mの値は他の試料と比較するとそれほど大きく はない。しかし、 $l^*$ の値は 50 時間試料では 2 番目に大きく、100 時間の中では一 番大きい。ST 試料と比較し、Hf 添加試料、Ta 添加試料はm、 $l^*$ も大きいことか ら、熱処理時間を更に増やした場合、より Nb<sub>3</sub>Sn 層を厚くし、 $l_c$ を増加させる可 能性がある。

表 4.2 に先行研究で調査された第三元素添加により Nb<sub>3</sub>Sn 層の熱処理時間依存 性が変化したときの時間の指数*m* [27]を示す。どの元素添加においても、熱処理 温度が高くなるにつれて*m*が増加している。よって、今回の試料で*m*が小さかっ た試料でも熱処理温度が高くなると、Nb<sub>3</sub>Sn 層の厚さが厚くなる可能性がある。 今後、第四元素添加により Nb<sub>3</sub>Sn 層の熱処理時間依存性の最適化の調査を行う には、様々な温度で試料を作製し、比較する必要がある。



|--|

	ST	Mg	Hf	Ge	Ga	Ta
т	0.320	0.008	0.538	0.720	0.944	0.440

表 4.2: 第三元素添加により Nb<sub>3</sub>Sn 層の熱処理時間依存性が変化したときの時間の指数m

.

	Heat treatment temperature [°C]	m
	700	0.33
Cu-7mass%Sn	800	0.33
	850	0.51
	700	0.76
Cu-7mass%Sn-Ti	800	0.91
	850	0.98
	700	0.37
Cu-7mass%-Hf	800	0.99
	850	1.01
Cu-7mass%-Ga	700	0.61
	800	0.63
	850	0.68

#### 4.2 推定した 0 K における $B_{c2}$

表 3.1、表 3.2 に示す測定から得られた各試料の $B_{c2}$ の温度依存性をゼロ磁界 まで外挿すると図 4.2 に示すように、実験値から得られた $T_c$ に比べて、若干低い  $T_c$ \*が得られる。これは、今回用いた試料サイズが大きいため Nb<sub>3</sub>Sn の生成の不 均一さが生じ、 $T_c$ がばらついた可能性がある。そこで本研究ではこの $T_c$ \*を各試 料の $T_c$ とした。その結果を表 4.3、表 4.4 に示す。

ここで、実験から得られた $B_{c2}$ から、下記の2つの手法を用いて低温度領域の $B_{c2}(T)$ を評価する。1つめの手法では次の式を用いる。 $B_{c2}(T)$ の温度依存性は経験的に

$$B_{c2}(T) = B_{c2}(0) \times \left[1 - \frac{T}{T_c^*}\right]$$
(4.2)

のように表せる。ここで、 $B_{c2}(0)$ は0 K における $B_{c2}$ の値である。この(4.2)式から $B_{c2}(0)$ を決定した。また、2 つめの手法では、第二種超伝導体における $B_{c2}$ を記述する WHH 理論を用いて、 $B_{c2}(T)$ の温度勾配から、

$$B_{c2}^{*}(0) = 0.693 \times T_{c}^{*} \left| \frac{\mathrm{d}B_{c2}}{\mathrm{d}T} \right|_{T = T_{c}^{*}}$$
(4.3)

の関係式を用いて 0K の $B_{c2}^{*}(0)$ も評価した。 $B_{c2}^{*}(0)$ は電子の平均自由行程が BCS のコヒーレンス長より十分に小さい極限(dirty limit)における上部臨界磁界の絶 対零度での値である。各試料の $B_{c2}(0)$ 及び $B_{c2}^{*}(0)$ を表 4.2 表 4.3 に示す。一般に (4.3)式から得られる $B_{c2}^{*}(0)$ に比べて、(2)式の評価の $B_{c2}(0)$ の方が若干過大評価さ れ、今回得られた結果も同様の傾向を示した。100 時間試料の中で一番高い $B_{c2}$ を示したのが Hf-100 で、一番低くなったのが Ga-100 である。また、50 時間試



図 4.2: 各試料における $B_{c2}$ の温度依存性をゼロ磁界まで外挿し、得られた $T_c$ \*の例

料の中で一番高い $B_{c2}$ を示したのが Mg-50 で、一番低くなったのが Ga-50 である。 $B_{c2}$ の最大、最小を示した試料と $J_c$ の最大、最小を示した試料が一致するため、 $J_c$ の向上は元素添加による $B_{c2}$ の変化によって生じている可能性がある。

表 4.3: 50 時間試料における推定されるT<sup>\*</sup><sub>c</sub>, B<sub>c2</sub>(0), B<sup>\*</sup><sub>c2</sub>(0)

	ST-50	Mg-50	Hf-50	Ge-50	Ga-50	Ta-50
$T_{c}^{*}$ [K]	16.5	16.7	16.7	16.2	16.4	16.4
$B_{c2}(0)$ [T]	28.7	31.7	29.3	29.2	25.3	30.7
$B_{c2}^{*}(0)$ [T]	19.9	22.0	20.3	20.1	17.5	21.3

表 4.4: 100 時間試料における推定されるT<sub>c</sub>\*, B<sub>c2</sub>(0), B<sub>c2</sub>(0)

	ST-100	Mg-100	Hf-100	Ge-100	Ga-100	Ta-100
$T_{\rm c}^{*}$ [K]	17.8	17.9	17.4	17.7	18.1	17.8
$B_{c2}(0) [T]$	32.4	34.0	37.4	34.5	29.9	36.6
$B_{c2}^{*}(0)$ [T]	22.4	23.5	25.9	23.1	20.7	25.3

#### 4.3 ピン力密度のスケール則による解析

規格化磁場 $b = B/B_{c2}$ とする。ピン力密度 $F_p \propto b^{\gamma}(1-b)^{\delta}$ をピン力密度のスケール則と呼ぶ。 $B_{c2}$ は4.2節に示す $B_{c2}(0)$ により求めた。

6-14 K における Hf-100 のピン力密度のスケール則の結果を図 4.3 に示す。 各温度において、b = 0.2において、 $F_p$ の最大値 $F_{pmax}$ を取り、低磁界部分が一致 している。しかし、6、10 K と 14 K とで高磁界部分が一致していない結果とな った。これは、14 K における $B_{c2}$ は実験で測定した結果の内挿により求めたが、 6、10 K における $B_{c2}$ は $B_{c2}$ の温度依存性が直線的に変化すると仮定した(4.2)式に より求めたためと考えられる。したがって、各試料におけるピン力密度のスケー ル則の比較は、14 K におけるピン力密度のスケール則の結果を用いて行う。

50 時間試料と 100 時間試料の 14 K における測定結果から得られたピン力密 度のスケール則の結果を図 4.4、4.5 に示す。また、各試料のピン力密度のスケー ル則における $\gamma$ と $\delta$ を表 4.5 に示す。各試料の $\gamma$ と $\delta$ が違うことから、第四元素添加 によりピンニング・パラメータが変化することがわかる。特に、Ga 添加試料に 関しては、50 時間試料、100 時間試料のどちらも $\gamma$ と $\delta$ が他の試料と比較し、極端 に悪い。したがって、Ga 添加試料は第四元素添加により $F_p$ が劣化したと考えら れる。この原因としては、Ga の添加量が他の試料より多い 5mass%であったた め、過剰添加により結晶粒が粗大化したと考えられる。ただし、Ga 添加試料を 除く試料において、50 時間試料と 100 時間試料とで大きく $\gamma$ と $\delta$ が変化していな いことから熱処理時間の違いによって、ピンニング・パラメータは大きく変化し なかった。したがって、Ga 添加試料を除く試料における $J_c$ 特性は $B_{c2}$ の変化によ って決定されていると考えられる。Ga 添加試料において、 $B_{c2}$ とともにピンニン グ・パラメータが大きく減衰しているため $J_c$ 特性の決定には $B_{c2}$ とピンニング・ パラメータのどちらが支配的に作用しているかの判断が難しいという結論に至 った。



図 4.3:6-14 K における Hf-100 のピン力密度のスケール則の結果





	1	× 4.3. 合政府化	<b>ルビン 万</b> 宿度	· <b>リ</b> ハク - 70 g	11(CADI) 27C	. 0	
		ST	Mg	Hf	Ge	Ga	Та
50 h	γ	0.50	0.46	0.52	0.49	0.78	0.53
50 h δ	2.25	2.20	2.31	2.48	3.74	2.70	
100 h	γ	0.48	0.48	0.55	0.57	0.32	0.60
100 h	δ	2.47	2.20	2.17	2.49	2.58	2.67

冬試料のピンカ密度のスケ -ル即におけろいと8

#### 4.4 磁束クリープ・フローモデルによる解析

この試料のピンニング特性を調べるために、磁東クリープ・フローモデルを用いて理論解析を行う。磁東クリープ・フローモデルの解析には各試料の実験結果から得られた $T_c^*$ 、 $B_{c2}(0 \text{ K})$ を用い、ピン力の代表値 $A_m$ 、磁界の依存性 $\gamma$ 、温度の依存性m、磁東バンドル内の磁束数 $g^2$ をピンニング・パラメータとして、実験の電界-電流密度(*E-J*特性)に一致するようにパラメータを決定した。表 4.6、4.7 に 50 時間試料、100 時間試料におけるピンニング・パラメータを示す。また、50 時間試料、100 時間試料の 6–14 K における $J_c$ -B特性の実験結果と解析結果の比較を図 4.6–4.7 に示す。パラメータから導出した $J_c$ -B特性が線、実験値の $J_c$ -B特性 がシンボルとなっている。

Ga 添加試料に注目する。Ga 添加試料の $A_m$ 、 $\gamma$ は他の試料と比較して小さく、  $B_{c2}(0 \text{ K})$ も低い。Ga 添加試料を除く試料は、 $A_m$ 、 $\gamma$ はほとんど変化せず、 $B_{c2}(0 \text{ K})$ が大きく変化している。

したがって、Ga 添加試料を除く試料の $J_c$ 特性は $B_{c2}$ の変化によって決定されていると考えられる。Ga 添加試料は $F_p \ge B_{c2}$ はともに他の試料と比較し減衰しているため、Ga 添加試料の $J_c$ 特性において、ピンニング・パラメータと $B_{c2}$ のどちらが支配的か判別できない結論に至った。これはピンカ密度のスケール則においても同様であった。

Ga-50 に注目すると、Ga-50 における $g^2 = 3.0$ は他の試料の値と比べて大きい。 これは、 $J_c$ が比較的小さいために、磁束線がピンニング・ポテンシャルから外れ るのを、バンドルサイズを大きくすることにより外れにくくするためであると 考えられる。

表 4.6:50 時間試料におけるピンニング・パラメータ

	$A_{\rm m}( imes 10^{10})$	$B_{c2}(0 \ \text{K})$	γ	m	$g^2$		
ST-50	5.30	28.7	0.55	1.30	1.00		
Mg-50	5.70	31.7	0.70	1.30	1.00		
Hf-50	5.10	29.3	0.70	1.25	1.00		
Ge-50	5.00	29.2	0.70	1.60	1.00		
Ga-50	1.70	25.3	0.30	1.20	3.00		
Ta-50	5.10	30.7	0.60	1.10	1.00		

表 4.7:100 時間試料におけるピンニング・パラメータ

	$A_{\rm m}( imes 10^{10})$	$B_{c2}(0 \text{ K})$	γ	m	$g^2$
ST-100	5.40	32.4	0.60	1.20	1.0
Mg-100	5.50	34.0	0.60	1.20	1.0
Hf-100	5.70	37.4	0.60	1.20	1.0
Ge-100	5.20	34.5	0.47	1.20	1.0
Ga-100	2.50	29.9	0.32	1.20	1.0
Ta-100	5.60	36.6	0.62	1.20	1.0



図 4.6:50 時間試料の 6-14 K におけるJ<sub>c</sub>-B特性の実験結果と解析結果の比較



#### 4.5 今後の研究

本研究では、Nb<sub>3</sub>Sn 用ブロンズ(組成: Cu-15Sn-0.3mass%Ti)に、第四元素として Mg, Ga, Ge, Hf, Ta を添加し、高磁界応用で重要な特性である $B_{c2}$ と $J_c$ 特性への影響について確認した。

熱処理時間の長い試料の方が $B_{c2}$ と $J_c$ 特性が優れる結果となった。よって、更に熱処理時間を長くした場合、更に $B_{c2}$ と $J_c$ 特性が優れる可能性がある。過去の研究において、最も熱処理時間の長い 200 時間試料の ST が第四元素添加された Ga 添加試料、Ta 添加試料と比較して最も $B_{c2}$ と $J_c$ 特性が優れる特性となった[28]。したがって、第四元素添加効果による $B_{c2}$ と $J_c$ 特性の向上の指標として、更に熱処理時間が長い場合の試料評価も行う必要がある。

今回の Mg、Hf、Ge 試料において、元素添加量は試験的に 0.5 mass%としたが、 Mg、Hf、Ta 添加試料の $B_{c2}$ と $J_c$ 特性は ST 試料の $B_{c2}$ と $J_c$ 特性より優れる結果とな った。したがって、添加量の最適化を行うことによって、更に $B_{c2}$ と $J_c$ 特性が向上 する可能性があるため添加量の最適化も行う必要がある。

### 第五章 総括

1954 年に発見された Nb<sub>3</sub>Sn は、国際熱核融合実験炉: ITER 計画におけるトロ イダル磁場コイル、中心ソレノイドコイル、核磁気共鳴分析器(NMR)等の高磁界 マグネット等に用いられる優れた超伝導材料である。特に、Nb3Snの上部臨界磁 界Bc2はNb-Tiに比べて2倍以上も高いことから様々な分野への利用が期待され、 更なる臨界電流密度J<sub>c</sub>特性向上が求められる。この Nb<sub>3</sub>Sn 線材の作製法には様々 な手法があり、その中でもブロンズ法は高磁界で高い」。特性が得られる。この手 法のブロンズへの少量のチタン(Ti)添加は、Nb3Sn 層への固溶に伴った空格子点 の増加により Sn の格子拡散係数を増大させ、結果的に Nb3Sn の結晶成長を促進 させる。同様な効果はハフニウム(Hf)でも報告されている。更にこの添加は結晶 粒の微細化による結晶粒界面の増加と、コヒーレンス長が短くなる効果から、L とBc2が向上する。同様に、タンタル(Ta)、ガリウム(Ga)添加によるBc2の増加、 ジルコニウム(Zr)、マグネシウム(Mg)、ゲルマニウム(Ge)添加によるJ<sub>c</sub>の増加が 知られている。よって、このような元素添加が Nb<sub>3</sub>Sn の新しい作製手法や特性 向上に有効に働く可能性がある。ただし、様々な元素添加やその組み合わせに関 した調査は十分でない。したがって、高特性を有する Nb<sub>3</sub>Sn 材料の開発のため には、どのような元素及び組み合わせがどの特性に有効なのかを明らかにする 必要がある。

以上の背景から、本研究では初期の試みとして Ti 添加された Nb<sub>3</sub>Sn 用ブロンズ(組成: Cu-15Sn-0.3mass%Ti)に、さらに第四元素として Mg, Ga, Ge, Hf, Ta を添加し、高磁界応用で重要な特性である $B_{c2}$ と $J_c$ 特性へどのような影響を与えるかについて調べた。

測定に用いた試料は、ブロンズ法で作製された Nb<sub>3</sub>Sn である。本研究ではブ ロンズに Ti を添加した Cu-15Sn-0.3Ti を試料作製の出発材料とし、このブロンズ に、第四元素として Mg(+0.5mass%)、 Hf(+0.5mass%)、 Ge(+0.05mass%)、 Ga(+5.0mass%)、 Ta(+0.08mass%)を添加した。熱処理時間は 50 時間、100 時間の 2パターン、700℃の熱拡散処理を行った。したがって、本研究に用いた試料は、 第四元素無添加の標準の試料と合せて全部で 12 種類である。試料の断面観察、 Nb<sub>3</sub>Sn 層の厚さの評価は、EMPA(電子プローブマイクロアナライザー)を用いて 行われた。

今回の実験では、第四元素添加により、 $J_c$ 、 $T_c$ 、 $B_{c2}$ が変化している可能性があった。したがって、測定では、4.2-14Kにおける直流磁化測定の結果から、各温度における $J_c$ -B特性を求めた。 $T_c$ 近傍における直流磁化率の温度依存性から $B_{c2}$ -T特性を求めた。ピンニング特性を調査するために、 $F_p = J_c \times B$ から $F_p$ -B特性を求め、その結果からピン力密度のスケール則による解析を行った。また、各試

料における $J_c$ の向上には、 $F_p \ge B_{c2}$ の変化のどちらが支配的かについて磁束クリ ープ・フローモデルを用いて調査するために、6-14Kにおける磁化緩和測定を 行い、その結果から各温度におけるE-J(電界-電流密度)特性を求めた。測定には SQUID 磁力計(MPMS3)を用いた。

直流磁化測定から $J_c$ -B特性を求めた。全ての元素添加試料の $J_c$ -B特性において、 熱処理時間の長い試料の方が $J_c$ の値が高い傾向にあった。また、50時間試料、 100時間試料のどちらにおいても、Ga添加試料の $J_c$ が一番低い結果となった。50時間試料においては、 $J_c$ の値は Mg-50で一番大きく、100時間試料においては、 $J_c$ の値は Hf-100で一番大きなった。各試料において、 $J_c$ が変化しているため第四 元素添加により $F_p$ または $B_{c2}$ が変化することがわかった。

0Kにおける $B_{c2}$ の推定を行った。100時間試料の中で一番高い $B_{c2}$ を示したのが Hf-100 で、一番低くなったのが Ga-100 である。また、50時間試料の中で一番高い $B_{c2}$ を示したのが Mg-50 で、一番低くなったのが Ga-50 である。 $B_{c2}$ の最大、最小を示した試料と $J_c$ の最大、最小を示した試料が一致するため、 $J_c$ の向上は元素添加による $B_{c2}$ の変化によって生じている可能性がある。

ピン力密度のスケール則( $F_p \propto b^{\gamma}(1-b)^{\delta}$ )による解析を行った。各試料のγと $\delta$ が違うことから、第四元素添加により $F_p$ が変化することがわかる。特に、Ga 添 加試料に関しては、50 時間試料、100 時間試料のどちらもγと $\delta$ が他の試料と比 較し、極端に悪い。したがって、Ga 添加試料は第四元素添加により $F_p$ が劣化し たと考えられる。この原因としては、Ga の添加量が他の試料より多い 5mass%で あったため、過剰添加により結晶粒が粗大化したと考えられる。ただし、Ga 添 加試料を除く試料において、50 時間試料と 100 時間試料とで大きくγと $\delta$ が変化 していないことから熱処理時間の違いによって、ピンニング・パラメータは大き く変化しなかった。したがって、Ga 添加試料を除く試料における $J_c$ 特性は $B_{c2}$ の 変化によって決定されていると考えられる。Ga 添加試料において、 $B_{c2}$ とともに  $F_p$ が大きく減衰しているため $J_c$ 特性の決定には $B_{c2}$ とピンニング・パラメータの 変化のどちらが支配的に作用しているかの判断が難しいという結論に至った。

磁束クリープ・フローモデルによる解析を行った。Ga 添加試料に注目する。 Ga 添加試料の $A_m$ 、 $\gamma$ は他の試料と比較して小さく、 $B_{c2}(0 \text{ K})$ も低い。Ga 添加試料を除く試料は、 $A_m$ 、 $\gamma$ はほとんど変化せず、 $B_{c2}(0 \text{ K})$ が大きく変化している。

したがって、Ga 添加試料を除く試料のJ<sub>c</sub>特性はB<sub>c2</sub>の変化によって決定されていると考えられる。Ga 添加試料はピンニング・パラメータとB<sub>c2</sub>はともに他の試料と比較し減衰しているため、Ga 添加試料のJ<sub>c</sub>特性において、ピンニング・パラメータとB<sub>c2</sub>のどちらが支配的か判別できない結論に至った。これはピンカ密度のスケール則においても同様であった。

Ga-50 に注目すると、Ga-50 における $g^2 = 3.0$ は他の試料の値と比べて大きい。

これは、J<sub>c</sub>が比較的小さいために、磁束線がピンニング・ポテンシャルから外れ るのを、バンドルサイズを大きくすることにより外れにくくするためであると 考えられる。

今後の研究について述べる。熱処理時間の長い試料の方がB<sub>c2</sub>とJ<sub>c</sub>特性が優れる結果となった。また、Nb<sub>3</sub>Sn層の熱処理時間依存性を(4.1)式でフィッティングした結果において、ST 試料と比較し、Hf 添加試料、Ta 添加試料はm、l\*も大きいことから、熱処理時間を更に増やした場合、より Nb<sub>3</sub>Sn層を厚くし、I<sub>c</sub>を増加させる可能性がある。よって、更に熱処理時間を長くした場合、更にB<sub>c2</sub>、J<sub>c</sub>特性と Nb<sub>3</sub>Sn 層厚がより優れる可能性がある。過去の研究において、最も熱処理時間の長い 200 時間試料の ST が第四元素添加された Ga 添加試料、Ta 添加試料と比較して最もB<sub>c2</sub>とJ<sub>c</sub>特性が優れる特性となった。したがって、第四元素添加効果によるB<sub>c2</sub>とJ<sub>c</sub>特性の向上の指標として、更に熱処理時間が長い場合の試料評価も行う必要がある。

今回の Mg、Hf、Ge 試料において、元素添加量は試験的に 0.5 mass%としたが、 Mg、Hf、Ta 添加試料の $B_{c2}$ と $J_c$ 特性は ST 試料の $B_{c2}$ と $J_c$ 特性より優れる結果とな った。したがって、添加量の最適化を行うことによって、更に $B_{c2}$ と $J_c$ 特性が向上 する可能性があるため添加量の最適化も行う必要がある。

## 参考文献

[1] B. T. Mattias, T. H. Geballe, S. Geller and E. Corenzwit: Phys. Rev. 95 (1954) 1435.

[2] T. G. Berlincourt and R.R. Hake: Bull. Am. Phys. Soc. 7 (1962) p.408

[3] J. R. Bednortz and K. A. Müler: Z. Phys. B-Condensed Matter. 64 (1986) 189.

[4] M. K. Wu, J. R. Asubuurn, C. J. Torng, P. H. Hor, P. L. Meng, L. Gao, Z. J. Haung,

Y. Q. Wang and C. W. Chu: Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 908.

[5] H. Maeda, Y. Tanaka, M. Fukutomi, T. Asano: J. Appl. Phys. 27 (1988) 209.

[6] 林 和彦、 増田 孝人: 電気設備学会 36 (2016) pp.787 – 790

[7] K. Hashi et al.: J. Magn. Reson. 256 (2015) p30

[8] M. Miura et al.: Scientific Reporters 4 (2016) p2499

[9] K. Zaitsu, S. Kawashima, Y. Murakami and T. Miyazaki: J. Cryo. Super. Soc. Jpn. 50 (2015) pp.180 – 185

[10] J. B. Vetrano and R. W. Boom: J. Appl. Phys. 36 (1965) pp.1179 – 1180

[11] K. Tachikawa: J. Cryo. Soc. Jpn. 45 (2010) pp.2 - 14

[12] K. Tachikawa and Y. Tanaka: J. Appl. Phys. 6 (1967) p782

[13] K. Nakagawa, K. Fukuda, G. Iwaki, K. Chida, H. Morita, T. Takeuchi, Y. Iijima, K. Inoue, K. Tagawa, T. Kiyoshi, K. Itou, H. Wada and N. Kobayashi: J. Cryo. Soc. Jpn. 33 (1988) pp.623 – 628

[14] K. Hashi, S. Ohki, S. Matsumoto, G. Nishijima, A. Goto, K. Deguchi, K. Yamada, T. Noguchi, S. Sakai, M. Takahashi, Y. Yanagisawa, S. Iguchi, T. Yamazaki, H. Maeda, R. Tanaka, T. Nemoto, H. Suematsu, T. Miki, K. K. Saito, T. Shimizu: J. Magn. Reson. 256 (2015) pp.30–33.

[15] Ultra-High Field Magnets at Bruker

https://sites.udel.edu/uhf-nmr-workshop/files/2015/08/Roth-1pjlsm2.pdf (参照:平成 30 年1月31日)

[16] 安藤俊就. "超電導コイル開発への道のり"

https://www.tia-nano.jp/ascot/tyoudendou/series-articles.html, (参照:平成 30 年 2 月 1 日)

[17] G. Lefranc and A. Müller: J. Less Common Metals 45 (1976) pp.399 - 413

[18] H. Taniguchi and A. Kikuchi: J. Cryo. Soc. Jpn. 47 (2012) pp.526 - 533

[19] Y. Hashimoto, K. Yoshizaki and M. Tanaka: Proc. ICEC 5 (1974) pp. 332 - 335

[20] K. Egawa, Y. Kubo, T. Nagai, T. Sone, K. Hiramoto, O. Taguchi, H.Kitakoga, M.

Wake, T. Shitomi and S. Nakayama: Advances in Cryogenic Engineering, 50 (2004) pp.403 – 409

[21] K. Tachikawa, N. Banno and Y. Miyamoto: J. Japan Inst. Met. Mater. 80 (2016)

pp.480-486

[22] T. Asano et. al.: J. Inst. Met. Mater. 47 (1983) pp1115-1122

[23] K. Tachikawa, H. Sekine and Y. Iijima.: J.Appl.Phys. 53 (1982) pp5354-5356

[24] H. Sekine, T. Takeuchi and K. Tachikawa: IEEE Trans. Magn. MAG-17 (1981) pp.383 – 386

[25] E. Helfand, N. R. Werthamer.: Phys. Rev. B 23 (1964) pp. 686 – 688

[daiichijisiken]

[26] M. Kiuchi, K. Noguchi, T. Matsushita, T. Kato, T. Hikata, K. Sato: Physica C 278 (1997) pp.62-70

[27] 生田目 雅章: 京都大学大学院工学研究科修士論文 (1987)

[28] 田邊 裕也、木内 勝、小田部 荘司、松下 照夫、 文珠 義之、 水田 泰 次、太刀川 恭治、 長村 光造: 電気学会研究会資料 44-55 (2016) pp.12-16

### 謝辞

本研究を行うにあたり、小田部 荘司教授から熱心なご指導を頂きまして,深 く御礼申し上げます。小田部先生には,研究全般の知識から価値観など多岐にわ たりご教授いただきました.

木内 勝准教授から,修士論文執筆にあたり多大な迷惑をお掛けし、人への指示の出し方から感情の制御など研究以外の事柄についてもご教授いただきました。

松下 照男名誉教授には、超伝導の基礎的な知識に関してご教授いただきました。

試料作製元である株式会社大阪合金工業所の水田 泰次氏、文珠 義之氏には このような稀有な研究を手伝える機会を頂き、深く感謝いたします。

物質・材料研究機構特別名誉研究員である太刀川 恭治生と益財団法人応用科 学研究所特別研究員である長村 光造先生からは、測定結果に対する考察から学 会の予稿の添削まで幅広くご助力頂き、感謝しております。

また、SQUID による Nb<sub>3</sub>Sn 試料の測定及び測定データの解析においては、学部 4 年の米中 友浩氏、米塚 里奈氏からご助力をいただきました。心から感謝申し上げます。

同期の谷村 賢太氏、柏木 啓氏、先輩である木戸 竜馬氏、平松 佑太氏、技術 職員の新山 誠二氏には、精神衛生面で支えてくださいまして感謝しています。

最後に、公私ともにお世話になりました、小田部・木内研究室の皆様に深く御 礼申し上げます。

# 研究業績

#### 国際学会

- 1. Y. Tanabe, *et al.*: "Upper critical fields and critical current densities of Nb<sub>3</sub>Sn doped with (Ti, Ta) or (Ti, Ga)", 29th International Symposium on Superconductivity, Tokyo International Forum, December 15 2016.
- 2. Y. Tanabe, *et al.*: "Upper critical fields and critical current densities of Nb<sub>3</sub>Sn doped with fourth elements", 30th International Symposium on Superconductivity, Iino Hall and Conference Center, December 15 2017.

### 国内学会

- 田邊 裕也,木内 勝,小田部 荘司,松下 照男,文珠 義之,水田 泰次,太刀 川 恭治,長村 光造「(Ti,Ta)または(Ti,Ga)を添加した Nb<sub>3</sub>Sn の上部臨界磁界 及び臨界電流密度特性」、電気・情報関係学会九州支部第 69 回連合大会、宮 崎大学 木花キャンパス 平成 28 年 9 月 30 日
- 田邊 裕也ら:「(Ti,Ta)または(Ti,Ga)を添加した Nb<sub>3</sub>Sn の上部臨界磁界及び臨 界電流密度特性」、超電導スクール 2016、産業技術総合研究所 つくば西 TIA 連携棟 平成 28 年 12 月 16 日
- 田邊 裕也ら:「(Ti,Ta)または(Ti,Ga)を添加した Nb<sub>3</sub>Sn の上部臨界磁界及び臨 界電流密度特性」、第 64 回応用物理学会春季学術講演会、パシフィコ横浜、 平成 29 年 5 月 15 日
- 田邊 裕也ら:「第四元素を添加した Nb<sub>3</sub>Sn の上部臨界磁界及び臨界電流密度 特性」、第78回応用物理学会秋季学術講演会、福岡国際会議場、 平成29年 9月6日